

# DTS

## Hieronder de situatie zoals die in 1991 was.

- **Devices, Technologie en Service (DTS)**
  - dr. U.K.P. Biermann
    - secretaresse: I. Zwiers
- Magneetkoppen en Glastechnologie
  - A.P. Severijns
    - Magneetkoppen: R. Smulders
    - Glasinstrumentmaken: J. Leijten
    - CO2-laser: M. Den Dekker
- Display atelier
  - ing. S. Van Heusden
    - Microvonkverspanen: J. Didden
    - Laserbewerkingen: W. Crooymans
    - Afmontage IC's: H. Bakermans
    - Pomperij: A. Janssen
- Chemische Technologie
  - dr. ir. G. Spierings
    - Halfgeleider technologie: J. Verhoeven
    - Chemische technologie: A. Venhuizen/W. Heyboer
    - Uitbesteden galvanisch werk: J. Clement
    - Chemisch-mechanisch-polijsten: T. Michielsen
    - Optische lagen: C. Van den Brekel
    - Depositie technieken: J. Van Glabbeek

## Hieronder de situatie zoals die in 1995 was.

- **Devices, Technologie en Service (DTS)**
  - dr. U.K.P. Biermann
    - secretaresse: I. Zwiers
- DTS – Magneetkoppen en Glastechnologie
  - A. Severijns
    - Glasinstrumentmaken/profieltrekken: J. Leijten
    - CO2-laser: M. Den Dekker
    - YAG-laser: J. Janssen
- DTS – Display atelier
  - S. Van Heusden
    - Microvonkverspanen: J. Didden
    - Laserbewerkingen: W. Crooymans
    - Afmontage IC's: H. Bakermans
    - Pomperij: A. Janssen
- DTS – Chemische Technologie
  - B. Spierings
    - Halfgeleider technologie: J. Verhoeven
    - Chemische technologie: B. Van der Putten/O. Remeus
    - Chemisch-mechanisch-polijsten: T. Michielsen
    - Optische lagen: J. Rijpers
    - Depositie technieken: H. Donkersloot
    - Laser Ablatie: K. Van den Brekel
- DTS – Microfabricage Centrum

- M. Verheijen
  - Microscopische ondersteuning: W. Gijsbers
  - SEM opnames: F. Holthuysen

**Hieronder de situatie zoals die in 1997 was.**

- **Devices, Technologie en Service (DTS)**
  - U. Biermann
    - secretaresse: I. Zwiers
- DTS – Fab-WA
  - Martin Verheijen
    - Magneetkoppen: Hans de Proost
    - Fiber-optische-componenten: Adie Verboven
    - YAG-laser: Jo Janssen
    - Afmontage IC's: Harrie Bakermans
    - Chemisch-mechanisch-polijsten: Theo Michielsen
    - E-beam lithografie: Jos Weterings
    - Proces technologie: Jan Verhoeven
    - Droog etsen: Eric van den Heuvel
    - Depositie dunne lagen: Henk Donkersloot
    - Optische lagen: Kees van den Heuvel
    - Bedrijfsbureau: Sjef Michielsen
    - CAD (o.a. voor maskers): Michel Bruyninckx
    - SEM inspecties: Chris Geenen/Frans Holthuijsen
    - Optische microscopie en preparatie: Wilma Gijsbers
    - Leiding cleanroom WA: Peter Sillen
    - Leiding Machining en Assemblage: Ad Severijns
- DTS – Fab-WZ
  - G. Spierings
    - Opdampen: J. Pasmans
    - Fotolithografie: J. v.d. Putten
    - Maskers: M. Van Baardwijk
    - Microvonkverspanen: J. Didden
    - Laserbewerkingen: W. Crooymans/ T. Den Dekker
    - Poederstralen: F. De Haas
    - Device realisatie: C. Peters/F. v. Laarhoven
    - Glastechnologie: J. Leijten
    - Technologie: S. Van Heusden